PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-014353

(43) Date of publication of application: 18.01.2002

(51)Int.CI.

G02F 1/1337 G02F G02F G02F

(21)Application number: 2000-197622

(71)Applicant : SONY CORP

SHARP CORP

(22)Date of filing:

30.06.2000

(72)Inventor: IMAI MASAHITO

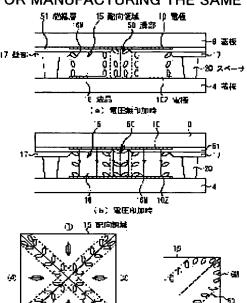
ENDO KAZUYUKI **UCHIDA TOSHIHISA**

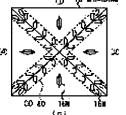
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve alignment of a liquid crystal display device using axial symmetry alignment.

SOLUTION: The liquid crystal display device is provided with a pair of substrates 4 and 8 disposed by facing each other through a prescribed clearance, liquid crystal 16 held in the clearance, and electrodes 10 and 10Z which apply an electric field to the liquid crystal 16 and change an alignment state. A wall structure 17 is formed at every region 15 subdivided along at least, one substrate 8 and aligns the liquid crystal included in each region 15 in axial symmetry when the electric field is applied. Similarly a groove structure 50 is formed at every region 15 and prepares an axial symmetry alignment state of the liquid crystal 16 in collaboration with the wall structure 17.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-14353

(P2002-14353A)

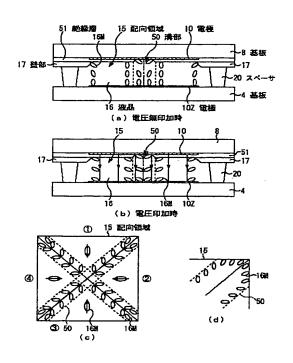
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(43)公開日	4 平成14年1	月18日 (2002	2. 1. 18)
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FI			テーマコート*(そ	多考)
G02F	1/1337	5 2 0	G 0 2 F	1/1337	520	2H0	8 8
	1/1333			1/1333		2H0	8 9
		505			505	2H0	9 0
	1/1335	505		1/1335	505	2H09	9 1
	1/139			1/137	505		
			審査請才	え 未請求	請求項の数13	OL (全	17 頁)
(21)出願番号	4	寺顧2000-197622(P2000-1976	22) (71)出願人	. 00000218!	5		
				ソニー株	式会社		
(22)出願日	2	平成12年 6 月30日 (2000. 6.30)		東京都品。	川区北品川6日	「目7番35号	
			(71)出願人	. 000005049	9		
				シャープ	株式会社		
				大阪府大	阪市阿倍野区 县	是池町22番22	号
			(72)発明者	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	人		
				東京都品	川区北品川6门	目7番35号	ソニ
			İ	一株式会	社内		
			(74)代理人	100092336	5		
				弁理士 4	鈴木 晴敏		
						•	
						最終耳	〔に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 軸対称配向を利用した液晶表示装置の配向性 を改善する。

【解決手段】 液晶表示装置は、所定の間隙を介して互 いに対向配置された一対の基板4,8と、間隙に保持さ れた液晶16と、液晶16に電界を印加してその配向状 態を変化させる電極10,102とを備えている。壁構 造物17が、少くとも一方の基板8に沿って細分化され た領域15毎に形成され、電界が印加された時各領域1 5に含まれる液晶を軸対称に配向する。 溝構造物 50 が 同じく領域15毎に形成され壁構造物17と共働して液 晶16の軸対称な配向状態を整える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の間隙を介して互いに対向配置された一対の基板と、

該間隙に保持された液晶と、

該液晶に電界を印加してその配向状態を変化させる手段 と、

少くとも一方の基板に沿って細分化された領域毎に形成され、電界が印加された時各領域に含まれる液晶を軸対 称に配向する壁構造物と、

同じく領域毎に形成され該壁構造物と共働して液晶の軸 対称な配向状態を整える溝構造物とを備えた液晶表示装 置。

【請求項2】 前記壁構造物は矩形の領域を囲む様に形成され、前記溝構造物は矩形の領域の対角線に沿って形成されている請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 各領域に含まれる液晶は、互いに交差する対角線によって四分割され、二本の対角線の交点に垂直な軸に対して対称的に配向されている請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記一方の基板は透明な板材からなりその一面にカラーフィルタ層、透明絶縁層及び透明導電層が形成されており、

前記溝構造物は、該板材、カラーフィルタ層、透明絶縁 層及び透明導電層の少くとも一層をパターン加工して形 成する請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記一方の基板は液晶に電界を印加する 手段として電極を有しており、

前記溝構造物は、該電極自体又は該電極の裏面若しくは 表面に配された絶縁膜に形成する請求項1記載の液晶表 示装置。

【請求項6】 前記液晶は誘電率異方性が負であり、両基板の表面は配向処理が施されており電界が印加されない状態で該液晶を垂直に配向する請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記液晶は、電界を印加した時に生じる 軸対称の配向状態を安定化する為に光重合性樹脂が添加 されている請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項8】 前記液晶は軸対称の配向状態が軸に沿って捻じれており、旋光性を利用して表示を行なう請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項9】 前記液晶は、その配向状態に捻じれを与えるためにカイラル物質が添加されている請求項8記載の液晶表示装置。

【請求項10】 前記液晶は軸対称の配向状態が軸に沿って捻じれておらず、複屈折性を利用して表示を行なう請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項11】 前記電界を印加する手段は、一方の基板に形成された列状の信号電極と、他方の基板に形成された行状の放電チャネルからなり、該放電チャネルは誘電体シートにより該液晶から隔てられている請求項1記

載の液晶表示装置。

【請求項12】 前記電界を印加する手段は、両方の基板に形成され、該液晶を間にして互いに対向する電極からなる請求項1記載の液晶表示装置。

05 【請求項13】 所定の間隙を介して互いに対向配置された一対の基板と、該間隙に保持された液晶と、該液晶に電界を印加してその配向状態を変化させる手段とを備えた液晶表示装置の製造方法において、

少くとも一方の基板に沿って細分化された領域毎に、電 界が印加された時各領域に含まれる液晶を軸対称に配向 する為の壁構造物を形成する工程と、

同じく領域毎に該壁構造物と共働して液晶の軸対称な配向状態を整える為の構構造物を形成する工程とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

15 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置及びその製造方法に関する。より詳しくは、液晶表示装置の広 視野角化を目的とした軸対称配向技術の改良に関する。

20 [0002]

【従来の技術】製造プロセスの簡便さや正面から見た時の表示特性の良さなどから、現在ツイストネマティック(TN)モードを用いた液晶表示装置がフラットディスプレイの主流となっている。しかし、TNモード液晶の欠点として視野角特性の狭さが挙げられ、特に大型のテレビなどに応用する場合問題となっている。これを解決する手段として様々な方法が提案されている。例えば、現在主流となっているのが、TNモードの液晶表示装置に光学補償フィルムを設けて広視野角化を図るものである。しかし、その改善効果は十分ではなく、しかも光学補償フィルムの大型化は特性の均一性などの点から難しい。

【0003】又、液晶表示装置に形成された個々の画素を複数の領域に分割し、各分割領域毎に配向状態を制御 する方法(画素分割法)がある。その具体的な実現手法が種々考案されている。例えば、フォトリソグラフィにより各画素に微細なマスクを形成し、ラビング方向(配向方向)の異なる複数の領域を形成する方法や、偏光紫外線を用いて配向方向を局所的に制御する方法などが知 られている。しかしながら、これらの方法は、プロセスでの基板汚染や材料に起因する信頼性の低下があり、実用には至っていない。

【0004】又、TNモード以外の液晶モードを用いて 広視野角化を図る技術が提案されており、例えばIPS 45 モード(特公昭53-48452号公報や特公平1-1 20528号公報)やMVAモード(特開平11-24 2225号公報)などが考案されている。IPSモード は基板面に平行な電界を用いて液晶を配向制御させるこ とで広視野角化を達成している。しかし、その特殊な動 50 作原理の為電極構造に大きな制限が生じ、開口率の低下 や応答速度の低下が問題となっている。MVAモードは 互いに対向する一対の基板の両面に突起構造を例えばフォトリソグラフィで形成し、液晶の配向状態を制御して 広視野角化を図る。しかしながら、互いに対向する基板 の両面に配向制御用の突起構造を形成するので、組立時 に両基板のアライメント精度が要求される。又、一対の 基板の内片側に対するフォトリソグラフィ加工が困難な パネル構造の場合には、MVAモードを適用することは できない。

【0005】上記の各手法とは別に、広視野角化を実現できる有力な手段として、ASMモード(Axially Symmetric Micro cell mode)が提案されている。ASMモードは、例えば特開平6-301015号公報、特開平7-120728号公報、特開2000-19522号公報などに開示されている。ASMモードは、一対の基板に保持された液晶が、細分化された領域の集合からなるとともに、個々の液晶領域は軸対称に配向制御されている。液晶配向の軸対称性により視角依存性を大幅に改善可能である。具体的には、片方の基板に沿って個々の領域毎に形成された壁構造物によって液晶分子をマルチドメイン配向させることにより、広視野角化が達成できる。特に、誘電異方性が負のn型液晶を用いたASMモードでは、広視野角で且つ高コントラストの液晶表示装置が実現されている。

【0006】図32は、従来のASMモードを採用した 液晶表示装置の構造並びに動作原理を示している。

(a)は電圧無印加状態を表わしている。図示する様に、下側の基板4と上側の基板8との間に液晶16が保持されている。両基板4,8の内面には、それぞれ液晶16に電界を印加する為の電極10Z,10が形成されている。上側の基板8の内表面には壁構造物17が形成されている。この壁構造物17は矩形の領域15を囲む様に形成されている。図示する様に、壁構造物17の壁面と液晶分子16Mとの間に初期配向が生じている。尚、一対の基板4,8はスペーサ20を介して互いに接合されている。

【0007】(b)は液晶16に電界を印加した時の状態を表わしている。(a)に示した様に電圧無印加時ほぼ垂直に配向していた液晶分子16Mは、電圧を印加することで水平配向に移行する。この時、液晶分子16Mと壁構造物17の壁面との間の初期配向の影響により、電圧印加時の分子配向が決定され、軸対称の配向状態が得られる。

【0008】(c)は電圧印加時の軸対称配向を模式的に表わした平面図である。矩形の領域15内で、液晶分子16Mは対角線の交点に垂直な軸を中心にして軸対称に配向している。基本的に、液晶分子16Mは領域15の四辺に向かって配向するが、対角線に沿った領域(ハッチングを付した部分)では領域15の各頂点に向かっ

て配向している。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】従来のASMモードで 得られる配向は図32の(c)に示した様にマルチドメ 05 イン配向であり、擬似的には8ドメイン配向と見なせ る。液晶ディスプレイとして表示を行なう為に、偏光軸 が直交した二枚の偏光板の間に液晶パネルを挿入する と、偏光軸と配向方向が直交若しくは平行にならないド メイン(ハッチングを付した部分)では光の利用効率が 10 低くなる為、シュリーレン模様又は矢車模様と呼ばれる 消光模様が生じてしまう。この為、駆動電圧/透過率特 性を測定すると、均一に配向している場合よりも透過率 が低くなり、電圧/透過率特性の急峻性が低下してしま う。又、配向状態を規制する要素が壁構造物の壁面であ 15 る為、配向領域15の中央部分では、配向規制力が弱く 配向状態の乱れや応答速度の低下が起こる。これを防ぐ 為に、液晶中に光重合樹脂を少量添加して配向規制力を 補っているが、プロセスの煩雑化及び添加剤による信頼 性低下が問題となっている。加えて、用いる光重合材料 20 やプロセスの条件によっては、残像発生の原因となって しまう。

[0010]

【課題を解決するための手段】上述した従来の技術の課題に鑑み、本発明は軸対称配向を利用した液晶表示装置の配向性を改善することを目的とする。かかる目的を達成する為に以下の手段を講じた。即ち、本発明にかかる液晶表示装置は、所定の間隙を介して互いに対向配置された一対の基板と、該間隙に保持された液晶と、該液晶に電界を印加してその配向状態を変化させる手段と、少30 くとも一方の基板に沿って細分化された領域毎に形成され、電界が印加された時各領域に含まれる液晶を軸対称に配向する壁構造物と、同じく領域毎に形成され該壁構造物と共働して液晶の軸対称な配向状態を整える溝構造物とを備えている。

【0011】好ましくは、前記壁構造物は矩形の領域を 35 囲む様に形成され、前記溝構造物は矩形の領域の対角線 に沿って形成されている。この場合、各領域に含まれる 液晶は、互いに交差する対角線によって四分割され、二 本の対角線の交点に垂直な軸に対して対称的に配向され ている。又、前記一方の基板は透明な板材からなりその 一面にカラーフィルタ層、透明絶縁層及び透明導電層が 形成されており、前記溝構造物は、該板材、カラーフィ ルタ層、透明絶縁層及び透明導電層の少くとも一層をエ ッチング、フォトリソグラフィ、グラインド等の方法で 45 パターン加工して形成する。又、前記一方の基板は液晶 に電界を印加する手段として電極を有しており、前記溝 構造物は、該電極自体又は該電極の裏面若しくは表面に 配された絶縁膜に形成する。又、前記液晶は誘電率異方 性が負であり、両基板の表面は配向処理が施されており 50 電界が印加されない状態で該液晶をホメオトロピック配

向、すなわち垂直に配向する。場合によっては、前記液 晶は、電界を印加した時に生じる軸対称の配向状態を安 定化する為に光重合性樹脂が添加されている。一態様で は、前記液晶は軸対称の配向状態が軸に沿って捻じれて おり、その旋光性を利用して表示を行なう。この場合、 前記液晶は、その配向状態に捻じれを与えるためにカイ ラル物質が添加されている。他の態様では、前記液晶は 軸対称の配向状態が軸に沿って捻じれておらず、その複 屈折性を利用して表示を行なう。具体的には、ホメオト ロピック配向とホモジニアス配向を切り換えて表示動作 を行なう。応用例では、前記電界を印加する手段が、一 方の基板に形成された列状の信号電極と、他方の基板に 形成された行状の放電チャネルからなり、該放電チャネ ルは誘電体シートにより該液晶から隔てられている。あ るいは、アクティブマトリクス型や単純マトリクス型等 の様に、両基板に互いに対向する電極を形成する場合も ある。

【0012】本発明によれば、各領域に含まれる液晶を軸対称に配向する壁構造物に加え、これと共働して液晶の軸対称配向を整える溝構造物を設けている。例えば、矩形の壁構造物の対角線上に溝構造物を設けることにより、従来の様な矢車模様の8ドメイン配向ではなく、二本の対角線で四分割された4ドメイン配向を実現できる。各ドメインで液晶は偏光板の偏光軸に対し平行若しくは直交に配向する為、透過率の損失がなく、従来に比し印加電圧/透過率特性が急峻になる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図1は、本発明に係る液晶表示装置の基本的な構造を示す模式図であり、図32に示した従来の液晶表示装置と対応する部分には対応する参照番号を付して理解を容易にしている。図1において

(a) は電圧無印加時の状態を表わし、(b) は電圧印加時の状態を表わし、(c) は電圧印加時における構造物形成基板近傍の液晶分子の軸対称配向状態を示し、

(d) は特に矩形の配向領域の頂点近傍における配向状態を模式的に表わしている。なお、TNモードでは、カイラル物質を添加すことで、対向基板側では配向方向が90°回転している。図示する様に、本液晶表示装置は、所定の間隙を介して互いに対向配置された一対の基板4、8と、この間隙に保持された液晶16と、液晶16に電界を印加してその配向状態を変化させる手段とを備えている。本実施形態では、この電界印加手段は、上側の基板8の内表面に形成された電極102とからなる。上側の基板8の内表面に形成された電極102とからなる。上側の基板8の内表面に形成された電極102とからなる。上側の基板8の内表面に形成された電域15を囲んでいる。壁部されており、細分化された領域15を囲んでいる。壁部17は、電界が印加された時領域15に含まれる液晶16を軸対称に配向する。本実施形態では、電極10の上に絶縁層51が形成され、その上に上述した壁部17が

形成されている。更に、壁部17には両基板4,8の間隙寸法を規定するスペーサ20が配されている。

【0014】本発明の特徴事項として、粛部(溝構造 物) 50が同じく各領域15毎に形成され、壁部17と 05 共働して液晶 16の軸対称な配向状態を整える。本例で は、この溝部50は絶縁層51に形成されている。本例 では、(c)に示す様に、壁部17は矩形の領域15を 囲む様に形成されている。又、溝部50は矩形の領域1 5の対角線に沿って形成されている。この場合、配向領 10 域15に含まれる液晶は、互いに交差する対角線に沿っ て四分割されている。図では、四分割された各ドメイン を
国
ー
國
で
表
わ
し
て
ある。
液
晶
分
子
1
6
M
は
、
二
本
の
対 角線の交点に垂直な軸に対して対称的に配向されてい る。即ち、ドメイン■及び■では液晶分子16Mが図面 15 上上下方向に配向し、ドメイン圏及び圏では液晶分子1 6 Mが図面上左右方向に配向している。尚、(d)に示 す様に、矩形の領域15の頂点近傍では液晶分子16M の配向方向が上下左右方向からずれ斜めになるが、その 範囲は面積的に見て微少であり、無視できる。尚、

) (a) に示す様に、本実施形態では、液晶16は誘電率 異方性が負であり、両基板4,8の表面は予め配向処理 が施されており、電界が印加されない状態で液晶16を 垂直に配向している。

【0015】以上説明した様に、本発明では両基板4, 8に施された垂直配向処理により、間隙間で液晶分子1 6Mは基板表面に垂直になる様に配向している。この 時、液晶分子16Mは壁部17の壁面や溝部50の壁面 (一般には斜面)に対して法線方向に配列する様にな る。実際には、基板8の内表面に沿って、壁部17及び 30 溝部50など全ての構造物の壁面から受ける垂直配向力 に対し、最もエネルギーが低くなる様な安定な方向に配 列する。この為、電圧を印加すると、(c)に示した様 に、配向領域15の対角線に沿って配向を補助する微細 な溝を設けたことにより、従来の様な矢車模様を含んだ 35 マルチドメイン配向(擬似的には8ドメイン配向)では なく、対角線で分割された4ドメイン配向を実現でき

【0016】図1に示した表示装置の基本構造は、例えばプラズマアドレス型の液晶表示装置に適用できる。こ40 こで、実施例の説明に入る前に、図2を参照してプラズマアドレス型液晶表示装置の基本的な構成を説明する。図2において、(a)は一画素分の正面図、(b)は同じく平面図、(c)は同じく側面図である。図示する様に、プラズマアドレス型の液晶表示装置は、画像信号になじて入射光を出射光に変調し画像表示を行なう表示セル1と、表示セル1に面接合しその走査(アドレシング)を行なうプラズマセル2とからなるフラットパネル構造を有する。プラズマセル2は行状に配列した放電チャネル5を有し、逐次プラズマ放電を発生して表示セル1を線順次で走査する。放電チャネル5は行状の空間を

形成する一対の隔壁 7 と、その間に配された一対のアノード電極A及びカソード電極Kとからなる。プラズマセル2の外表面には位相差板26と偏光板19が貼り付けられている。一方、表示セル1は列状に配列した信号電極10を有し放電チャネル5との交差部分に画素11を形成するとともに、線順次走査に同期して画像信号を印加し画素11年に入射光の変調を行なう。

【0017】表示セル1とプラズマセル2は極薄のガラ ス板などからなる中間シート (誘電体シート) 3によっ て互いに隔てられている。プラズマセル2は中間シート 3に下側から接合したガラス基板4を用いて構成される 一方、表示セル1は中間シート3に上側から接合したガ ラス基板8を用いて構成されている。基板8と中間シー ト3との間の間隙には表示媒体として液晶16が保持さ れている。間隙寸法はスペーサ20によって規定されて いる。液晶16は上下から配向膜21により挟まれてお り、電圧無印加状態では垂直配向状態となっている。液 晶16は細分化された領域15の集合からなり、図では 一個の領域15のみが示されている。個々の領域15に 含まれる液晶16は壁部17によって軸対称に配向制御 されている。軸対称配向した液晶16は視角依存性を顕 著に改善することができる。領域15内で軸対称配向し た液晶分子のリターデーションが相互に補償されるの で、各視角方向からの光線の透過率が平均化され、視角 依存性が弱められる。本例では、軸対称の配向状態が基 板に垂直な軸に沿って捻じれており、その旋光性を利用 して表示を行なう。尚、基板8の内表面にはカラーフィ ルタ13も形成されており、各画素11に対してRGB 三原色を割り当てる。各画素は、カラーフィルタ13に 格子状に形成されたブラックマスクBMによって仕切ら れている。カラーフィルタ13と信号電極10との間に は透明な絶縁材料からなる平坦化膜9が介在している。

【0018】図3は画素を二個だけ切り取って示した模 式図である。この図においては、理解を容易にする為に 2本の信号電極101,102と1本のカソード電極K 1と1本のアノード電極A1のみが示されている。個々 の画素11は、信号電極101,102と、液晶16 と、中間シート3と、放電チャネルとからなる積層構造 を有している。放電チャネルはプラズマ放電中ほぼ実質 的にアノード電位に接続される。この状態で各信号電極 101,102に画像信号を印加すると液晶16及び中 間シート3に電荷が注入される。一方、プラズマ放電が 終了すると放電チャネルが絶縁状態に戻る為浮遊電位と なり、注入された電荷は各画素11に保持される。いわ ゆるサンプリングホールド動作が行われている。従っ て、放電チャネルは個々の画素11に設けられた個々の サンプリングスイッチング素子として機能するので模式 的にスイッチングシンボルSW1を用いて表わされてい る。一方、信号電極101,102と放電チャネルとの 間に保持された液晶16及び中間シート3は、サンプリ

ングキャパシタとして機能する。線順次走査によりサンプリングスイッチSW1が導通状態になると画像信号がサンプリングキャパシタにホールドされ、信号電圧レベルに応じて各画素の点灯あるいは消灯動作が行われる。

- 05 サンプリングスイッチSW1が非導通状態になった後に も信号電圧はサンプリングキャパシタに保持され表示装 置のアクティブマトリクス動作が行われる。なお、実際 に液晶16に印加される実効電圧は中間シート3との容 量分割により決定される。
- 10 【0019】図4は、図2に示した表示セルの製造方法を示す工程図である。まず工程(a)で、ガラス基板8の片面にカラーフィルタ及び信号電極を形成する。なお、理解を容易にする為、ガラス基板8は信号電極及びカラーフィルタを含めた形で単純化して表わしてある。
- 15 工程(b)で、ガラス基板8の表面に壁部17を格子状に形成する。例えば、感光性樹脂を塗布した後格子パタンを有するフォトマスクを介して露光現像(フォトリソグラフィ)を行うことで、壁部17を形成することができる。工程(c)で、壁部17の頂部に、スペーサ20を離散的にパタニング形成する。これもフォトリソグラフィを用いることができる。工程(d)で、壁部17及びスペーサ20が形成されたガラス基板8の表面をポリイミドなどの垂直配向剤21で被覆する。以上の工程(a)~(d)と平行して、工程(a)でプラブスセル
 - (a) ~ (d) と平行して、工程 (e) でプラズマセル 2 を作成しておく。プラズマセル 2 はガラス基板と中間 シートとの間に放電チャネルを設けたものである。図では、プラズマセル 2 を単純化して表わしており、下面側 に中間シートが位置する。工程 (f) で、プラズマセル 2 の中間シート側の表面に、あらかじめ垂直配向剤 2 1 を塗工しておく。

【0020】工程(g)で、プラズマセル2とガラス基板8を互いに接合する。両者の間隙寸法は壁部17及びスペーサ20によって画面全体に渡り一定に制御できる。この様にして形成された表示セルの内表面は全て垂35 直配向剤21によって被覆されることになる。工程

- (h)で、真空注入方式などにより表示セルの内部に被晶16を注入する。液晶16は実際には混合物であり、n型のネマティック液晶材料、カイラル物質、モノマー、光開始剤などを含んでいる。最後に工程(i)で、
- 40 液晶領域15を軸対称に配向制御する。まず、液晶16 に所定の交流電圧を印加し、壁部17の壁面効果を利用して液晶分子を軸対称配向状態とする。この後軸対称配向状態を固定する為、高圧水銀ランプなどで紫外線を照射する。これにより、モノマーが光重合化し、液晶領域45 15の軸対称配向状態を記憶させる。

【0021】図5は、図4に示した製造方法により作成された表示セルの動作を模式的に表わしたものである。 電圧を印加したON状態では、液晶領域15は軸対称配向を維持している。印加電圧を解除したOFF状態で

50 は、液晶領域15に含まれる液晶分子は垂直配向に移行

する。ON状態とOFF状態は印加電圧のオン/オフにより可逆的に切り換えることができる。偏光板などを用いて、軸対称配向と垂直配向間の相変化を透過率の変化として取り出すことで、表示が行われる。

【0022】図6は、軸対称配向モードを採用した表示 セル1の光学的な機能を模式的に表わしたものである。 表示セル1の上下にはそれぞれ偏光板18,19が配さ れている。偏光板18,19の偏光軸を矢印で表わして ある。両偏光板18,19の偏光軸は互いに直交してお りクロスニコル配置である。なお、表示セル1と偏光板 18との間に位相差板25が配されており、表示セル1 と偏光板19の間にも位相差板26が配されている。こ れらの位相差板25,26は垂直配向状態における液晶 分子に対して傾いた方向から光が入射した時の位相差を 補償するために用いられる。位相差板25,26は例え ば負の二軸性複屈折板を用いることができる。図では、 表示セル1は軸対称配向状態にある。ただし、液晶分子 のダイレクタは軸方向に沿って90°回転している。上 側の偏光板18を通過した直線偏光は表示セル1で偏光 軸が90°回転し、クロスニコル配置した偏光板19を 通過する。これにより、明表示が得られる。表示セル1 が軸対称配向状態から垂直配向状態に移行すると、直線 偏光に対する旋光能が失われる。従って、偏光板18を 通過した直線偏光はそのまま偏光板19に到達すること になる。直線偏光は偏光板19の偏光軸と直交している 為、入射光は遮断される。これにより暗表示が得られ

【0023】図7は、図2に示したプラズマアドレス型 の液晶表示装置に本発明を適用した実施形態を示す模式 図である。理解を容易にする為、図2に示した基本構造 と対応する部分には対応する参照番号を付してある。前 述した様に、プラズマアドレス型の液晶表示装置は、表 示セル1とプラズマセル2を中間シート (誘電体シー ト) 3で互いに接合した構造である。表示セル1は、カ ラーフィルタ13やITOなどの透明な信号電極10を 有するCF基板8と、中間シート3との間に保持された 液晶16で構成されている。特徴事項として、矩形の壁 部17で囲まれた領域15に、溝部50が形成されてい る。本例では、溝部50は矩形の領域15の対角線に沿 って形成されている。この溝部50は、信号電極10の 上に形成された絶縁膜51をパターン加工して設ける。 具体的には、フォトリソグラフィ、エッチング、クライ ンド等を行なう。一方、プラズマセル2は下側のガラス 基板4を用いて形成されており、中間シート3との間に 密閉された放電チャネル5を設けてある。以下、本明細 書ではプラズマセル2をその土台となるプラズマ (P L) 基板4で表わす場合がある。

【0024】図8は、図7に示したプラズマアドレス表示装置の製造方法を示すフローチャートである。ステップS1でCF基板の基本構造を形成する。具体的には、

ガラスなどからなる基板の一面にカラーフィルタを形成 してCF基板とする。ステップS2でITOなどの透明 導電膜を形成し、フォトリソグラフィ及びエッチングで 所定の形状にパターニングして信号電極に加工する。続 05 いてステップS3で溝構造を形成する。具体的には、ス テップS31の樹脂膜塗布、ステップS32のプリベー ク、ステップS33の露光、ステップS34の現像、ス テップS35の焼成などが含まれる。即ち、CF基板の 信号電極表面にフォトリソグラフィ処理などを用いてア 10 クリル樹脂などの誘電体をパターニングすることで対角 線上に溝を形成する。溝の深さ(樹脂の厚み)は原理的 には特に制限はない。但し、樹脂の透過率による画素透 過率の低下、電圧無印加状態での溝壁面からの光抜けに よる黒輝度の上昇を考慮すると、溝の深さは2μm以下 15 にすることが望ましい。又、溝壁面の傾斜角は、同様の 理由から45度以下にすることが望ましい。この様に形 成された溝構造体の上に、ステップS4で液晶分子の配 向を軸対称に制御する壁構造を形成する。具体的には、 黒色又は透明なアクリル樹脂などの誘電体をフォトリソ 20 グラフィ処理及びエッチング処理などでパターニングす ることにより形成する。壁の高さ(樹脂の厚み)は、原 理的には特に制限はないが、透過率の向上などを目的と して透明な材料を用いる場合、樹脂の透過率による画素 透過率の低下、電圧無印加状態での壁面からの光抜けに 25 よる黒輝度の上昇、及び液晶注入プロセスの時間短縮な どを考慮すると、壁構造の高さ寸法は2μm以下若しく は基板間隙(セルギャップ)dの半分以下にすることが 好ましい。又、壁構造に含まれる壁面の傾斜は45度以 下に設定することが望ましい。尚、セルギャップは用い る液晶材料の光学特性によって最適化する必要がある。 次にステップS5で、壁構造の上部にセルギャップを規 定する為のスペーサ(柱構造)を形成する。スペーサ は、表示画素領域以外の部分に形成される。溝構造や壁 構造と同様に、柱構造もアクリル樹脂などの誘電体をフ 35 ォトリソグラフィ処理及びエッチング処理することでパ ターニングして形成する。スペーサの高さは、一般に液 晶材料の屈折率異方性 △nの大きさに従ってリターデー ション(d·Δn)の最適値から計算されるセルギャッ プdに合せて設定するとよい。本実施形態では、セルギ 40 ャップが 6 μ m となる様にスペーサの高さ寸法を決めて いる。スペーサ壁面での偏光解消による光漏れを防ぐ 為、誘電体(絶縁体)は黒色材料を用いるか、スペーサ をブラックマスク上に形成することが望ましい。以上に より、CF基板が完成する(ステップS6)。 【0025】CF基板の作成と平行して、ステップS8

45 【0025】CF基板の作成と平行して、ステップS8でPL基板を形成しておく。特に本発明に固有の処理は必要でなく、ステップS9でPL基板が完成する。ここで、完成したCF基板の表面に垂直配向処理(ステップS7)を施すとともに、PL基板にも垂直配向処理(ス50テップS10)を施す。一般に、垂直配向処理は、ポリ

イミド樹脂などに垂直配向性を付与した材料を基板表面 に塗布することで行なわれる。配向処理終了後の両基板 は、ステップS11で配向処理表面を内側にして貼り合 わされる。更に、ステップS12で両基板の間隙に液晶 材料を封入する。封入方法としては、セルギャップ内を 概ね真空状態にし、液晶材料を注入口から封入後、注入 口を封止する方法が採用可能である。あるいは、貼り合 わせる前に一方若しくは両方の基板上に液晶材料を塗布 し、貼り合わせと同時に封入する方法がある。この様に して、個々の配向領域に壁構造及び溝構造を形成したA SM液晶では、従来必要であった光重合性樹脂による配 向固定処理(軸出し処理)が不要になる。尚、材料系や 用途によって強いアンカリングを必要とする場合は、予 め微量の光重合性樹脂及び光重合開始剤を混入してお き、液晶ギャップ間に電圧を印加した状態で光重合性樹 脂を反応させ、軸出し処理を行なう。この様にして形成 されたプラズマアドレス液晶パネル (PALCパネル) を、直交ニコル配置にある偏光板と黒視野角特性補正用 の位相差フィルムで挟むことで、本発明を適用したPA LC方式の液晶表示装置が完成する (ステップS1

【0026】図9は、図7に示したプラズマアドレス型液晶表示装置を最も単純化した等価回路図である。表示セルに含まれる液晶層が容量 C_{LC} で表わされ、表示セルとプラズマセルを隔てる中間シート(誘電体層)が容量 C_i で表わされる。直列接続された C_{LC} と C_i の両端に画像信号が印加される。液晶層に実際に印加される駆動電圧は容量分割された分である。

【0027】図10は、プラズマアドレス型の液晶表示装置の軸対称配向をモデル化した図である。図中実線矢印は、構造物形成基板側の配向方向を示し、破線矢印は対向する基板側の配向方向を示す。円弧矢印はカイラル効果による分子配向のねじれ方向を示す。又、実線の双頭矢印は構造物形成基板側の偏光板の向きを示し、破線の双頭矢印は対向する基板側の偏光板の向きを示す。以下同様である。(a)は図7に示した本発明の液晶表示装置の軸対称配向を表わしており、配向領域15は対角線で四分割されており、4ドメイン配向となっている。

- (b) は図2に示したプラズマアドレス表示装置の軸対 称配向を表わしており、シュリーレン模様若しくは矢車 模様が現れた軸対称配向となっている。(c)は、
- (b) に示した実際の配向をモデル化したものであり、 ほぼ8ドメイン配向と見なせる。

【0028】図11は、図9及び図10に示したモデルを採用して、プラズマアドレス型液晶表示装置の透過率/駆動電圧特性をシミュレーションした結果である。カープAは4ドメイン配向のシミュレーション結果であり、カープBは8ドメイン配向のシミュレーション結果である。グラフから明らかな様に、壁構造物に溝構造物を組み合わせた本発明の配向方式により、駆動電圧/透

過率特性の急峻性は大幅に改善され、より低い駆動電圧 で高い透過率が得られる。

【0029】図12は、視野角特性のシミュレーション結果を表わしており、(a)は4ドメイン配向の場合での場合である。各グラフにおいて、横軸は画面の左右方向を表わし、縦軸は画面の上下方向を示している。又、同心円を用いて基板に対する視角方向を示している。グラフに示された曲線は、等コントラスト曲線であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは等コントラストを2020であり、グラフは第二の上で表示している。(2020であり、2020であ

【0030】次に、表示性能に大きく影響する溝構造の 15 深さ寸法について説明する。図13は、図1に示した単 純構造の液晶表示装置をモデル化して表わしたものであ る。溝部50が形成された絶縁膜51の比誘電率をεa で表わし、その厚みをdaで表わしてある。従って、溝 の深さはdaにほぼ等しい。又、互いに対向する電極1 20 0, 102の間の寸法はd,で表わされている。又、壁 部17で囲まれた領域15において、溝が形成されてい ない部分の厚みはd゚で表わされている。加えて、液晶 16の比誘電率を ϵ_{10} で表わしてある。図示の様に、領 域15の大半が溝部50を形成する絶縁膜51を介して 25 電圧印加される為、溝深さ分の容量による電圧降下が生 じる。電圧降下量は溝の深さに比例して大きくなる。 【0031】図14は、図13にモデル化した液晶表示 装置の等価回路図である。溝部は液晶層のみで構成さ れ、溝部以外は絶縁層51と液晶層16の直列接続で表 わされる。ここで、一対の電極10,102間に印加さ れる電圧をVとし、溝部の液晶層に印加される実効電圧 をV、とし、溝部以外の液晶層に印加される実効電圧を V_{i} で表わしている。尚、 V_{o} は、溝の深さが0の時に 印加すべき駆動電圧を表わしている。換言すると、壁構 35 造のみで溝構造が形成されていない場合の駆動電圧を表 わしている。

【0032】図15は、図13及び図14に示したモデルを用いたシミュレーション結果を表わしている。縦軸に等透過率入力電圧比(V/V_0)を取り、横軸に溝深40 さdaを取ってある。ここで直線Aは絶縁膜51の比誘電率 ϵ_a が10の場合を表わし、直線Bは同じく比誘電率 ϵ_a が10の場合を表わしている。溝部が形成されていない場合に所定の透過率を得る為に必要な駆動電圧を V_0 で表わしてある。溝部を形成した場合に、同じ透過率45 を得る為に必要な駆動電圧をVで表わしてある。グラフから明らかな様に、同じ透過率を得る為の駆動電圧 V_0 は、溝の深さに比例して大きくなる。この為、溝の深さ V_0 は、溝の深さに比例して大きくなる。この為、溝の深さ V_0 0 和である。

50 【0033】図16は、縦軸に液晶部印加電圧比(V2

/V1)を取り、横軸に溝深さdaを取ったシミュレー ション結果である。前述した様に、V1は溝部以外の液 晶層に印加される電圧を表わし、V2は溝部の液晶層に 印加される電圧を表わしている。グラフから明らかな様 に、溝深さdaが大きくなる程、V1に対するV2の比 が大きくなっている。この様に、溝部の存在により電圧 が掛かり易くなるとともに、溝部が深くなる程溝斜面の 面積が増加する為、配向規制力が高くなる。従って、軸 対称配向を実現する為の配向規制力の観点から見ると、 溝深さdaはできるだけ大きくした方が有利である。以 上のシミュレーション結果から、セルギャップの設定す 法が6μm程度の場合、溝深さは0.5~2μm程度に するのが好ましい。但し、絶縁膜51による電圧降下量 はその比誘電率 ε a によって調整可能である。図15の 直線AとBを比較すれば明らかな様に、比誘電率 ϵ a ϵ 大きくすることで、低消費電力化が可能である。

【0034】図17は、単純マトリクス型の液晶表示装置ではなく、図7に示したプラズマアドレス型の液晶表示装置をモデル化した模式図である。単純マトリクス型のモデルを表わす図13と比較すれば明らかな様に、プラズマアドレス型では下側の電極に代えて中間シート3の裏面に仮想電極2Zはプラズマセル(図示せず)側のプラズマ放電によって発生するものである。尚、極薄の誘電体などからなる中間シート3の比誘電率を ϵ iで表わし、その厚みをdiで表わしてある。

【0035】図18は、図17に示したモデルの等価回路図である。図14に示した単純マトリクス型のモデルと対応する部分には対応する参照番号を付してある。異なる点は、溝部及び溝部以外共に、中間シート3からなる誘電体層の容量が付加されていることである。従って、溝部では誘電体層と液晶層で容量分割された分が液晶層に印加される電圧V,となり、溝部以外では絶縁層、液晶層及び誘電体層で容量分割された分が液晶層に印加される駆動電圧V」となる。

【0036】図19は、図17及び図18に示したモデルを用いたシミュレーション結果を表わしており、縦軸に等透過率入力電圧比(V/V0)を取り、横軸に溝深さdaを取ってある。図15と図19を比較すれば明らかな様に、プラズマセルと表示セルを隔てる誘電体シート3と液晶層16との容量分割効果により、溝深さを大きくした場合の入力電圧の変化が小さくなり、従って電力損失が小さくなる。

【0037】一方、図20は液晶部印加電圧比(V2/V1)の構深さ依存性を表わすグラフである。プラズマアドレス型の場合であっても、配向領域の構部以外に比較して構部は液晶層の厚みが大きくなるため容量はその分小さくなり、図20のグラフに示す様に構部に印加される電圧は大きくなる。特に、図16と図20を比較すれば明らかな様に、構部に印加される電圧がより大きく

なる為、強い配向規制力が得られ、配向安定性が向上する。図19及び図20に示した様に、溝構造をプラズマアドレス型の液晶表示装置に適用した場合は、溝構造を形成する絶縁材料の比誘電率変化に対して効果の変動が05 小さい為、材料選択の幅が広がる。

【0038】図21は、図1に示した単純マトリクス型の液晶表示装置の変形例を表わす模式的な断面図である。図1と対応する部分には対応する参照番号を付して理解を容易にしている。本例では、ブラックマトリクス10 BMを含むカラーフィルタ13の下に、平坦化膜9を介して透明電極10を設けてある。この透明電極10自体をエッチングして溝部50を設けている。本例は、溝部を形成する為に追加の絶縁膜を用いていないので、その電圧降下の影響を避けることが可能である。尚、電極10を直接エッチングしてしまうと、溝部50には電界が印加されないが、図示の様に周囲からの電界の広がりが生じる為、より強い溝配向の効果が得られる。

21と対応する部分には対応する参照番号を付してあ 20 る。本例は透明電極10を比較的厚く形成し、その厚み 分を部分的にエッチングして溝部50を得ている。溝部 50の表面全体が導電材料で形成される為、絶縁膜の介 在による電圧降下が生じない。従って、電力の損失がな

【0039】図22は、他の変形例を表わしており、図

5 【0040】図23は、別の変形例を示す模式的な部分 断面図である。本例では、平坦化膜9と電極10との間 に、絶縁膜51を設け、これをエッチングすることで構 部50を得ている。この場合も、溝部50は透明電極1 0で完全に被覆される為、電圧降下は生じない。

30 【0041】図24は、更に別の変形例を表わしており、図23と対応する部分には対応する参照番号を付して理解を容易にしている。図23と異なる点は、構部50の斜面ばかりでなく、壁部17の斜面にも電極10を延在させて、壁部17の側壁による電圧降下も除去する35ものである。

【0042】図25は、図7に示したプラズマアドレス型の液晶表示装置の変形例を示す模式的な部分断面図であり、特に表示セル1の部分のみを表わしている。本例では、カラーフィルタ13を構成する着色樹脂膜の一部40を部分的にエッチングして溝部50を得ている。

【0043】図26は、別の変形例を表わしており図25と対応する部分には対応する参照番号を付して理解を容易にしている。本例では、カラーフィルタ13と電極10との間に介在する平坦化膜9を選択的にエッチングして溝部50を形成している。

【0044】図27は、更に別の変形例を表わしており、図26と対応する部分には対応する参照番号を付してある。本例では、ガラス板などからなる基板8の内表面を部分的にエッチングして溝部50を得ている。

50 【0045】図28は、図1の(c)に示した溝構造の

変形例を表わす平面図である。矩形の配向領域15の内部には対角線に沿って構部50が形成されている。この構部50は矩形領域15の周辺から中心に向かうに従って構幅が拡大している。係る構成により、ハッチングを付した構部50の内部で矢印方向の配向規制力が強くなり、乱れを抑制することが可能である。

【0046】以上に説明した実施例では、何れもTNモ ードを採用しており、セルギャップ間で液晶分子の配向 方向が例えば90度捻じれる様に配向させている。通常 は、上下の基板面のラビング方向を直交させることで捻 じれ配向を実現させているが、n型のネマティック液晶 を用いたASMモードでは、電圧印加時に90度の捻じ れ配向が生じる様に、液晶にカイラル物質を添加してい る。捻じれ量は、用いる液晶材料やカイラル物質とその 添加濃度で決まる。TNモードの光学動作は、液晶分子 配向に沿って生じる旋光性に基づく。TNモードに代え て、電界制御複屈折(ECB)モードを採用することも 可能である。ECBモードでは、液晶にカイラル物質を 添加せず、液晶分子は電圧印加時には捻じれることなく 配向する。これをホモジニアス配向と呼ぶ。光学動作は 液晶分子の複屈折効果に基づく。そのため、偏光板は、 分子の配向方向に対して45°傾けたクロスニコル配置 にする必要が有る。図29は、ECBモードを採用した 場合のプラズマアドレス液晶表示装置の透過率/駆動電 圧特性を示すグラフである。図29のグラフは、TNモ ードを採用した図11のグラフに対応している。グラフ 中カーブAは溝構造を追加した4ドメイン配向の透過率 /駆動電圧特性を表わし、カーブBは溝構造を追加せず TNモードを採用した8ドメイン配向、すなわち従来技 術ASMの特性をシュミレートした結果であり、図11 のBと同じものを示す。グラフから明らかな様に、EC Bモードでも壁構造に溝構造を付加することで透過率/ 駆動電圧特性を急峻にできる。更には、図11のカーブ Aと図29のカープAを比較すれば明らかな様に、TN モードに比べECBモードの方が透過率/駆動電圧の急 峻性がより顕著である。

【0047】図30は、壁構造パタン及び構構造パタンの組み合わせの変形例を示す模式図である。本例では、壁構造17が配向領域内で斜め方向に形成される一方、構構造50は横方向に形成されている。これら壁構造17と構構造50の組み合わせにより、液晶分子は矢にないで、立て、上ではからでは、近れた一対の偏光板を液晶パネルに上下がはり合わせる必要があるが、この時各偏光板の偏光性には、偏光板の偏光軸はでは、偏光板の偏光軸は画面の左右方向及び上下方向とは、偏光板の偏光軸は画面の左右方向及び上下方向とれぞれ平行になる。一般に、黒表示の場合の視角特性は偏光軸方向に有利となる為、図12に示したTNモード

の視角特性と同様な視角特性を得ることが可能である。 【0048】図31は、図30に示した実施例の変形例 を表わしている。この例でも壁構造17は矩形領域の対 角方向に形成される一方、溝領域50は矩形領域の辺と 05 平行に形成されている。一方、液晶分子は図30と同様

平行に形成されている。一方、液晶分子は図30 に斜め方向に配向している。

[0049]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、壁構造に加え溝構造を形成することで、完全な4ドメイ10ン配向が得られ、従来の擬似8ドメイン配向に比較して広視野角化が可能である。又、矢車状の消光領域がなくなる為、光の利用効率が向上し、高透過率化が可能になる。加えて、透過率/駆動電圧特性の急峻性が向上し、液晶の低電圧駆動化が可能となる。更に、低電圧駆動化15によりクロストークの発生を抑制できる。又、矩形の配向領域の中央部にも溝構造として配向規制要素を設けることができる為、配向規制力が向上し、光重合樹脂などの補助配向処理を必要としなくなる。液晶表示装置の画素と1対1に対応する様に配向領域を拡大しても、配向30が安定である。加えて、従来の様に配向渦を生じない為、応答速度が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る液晶表示装置の基本構成を示す模式図である。

25 【図2】プラズマアドレス型の液晶表示装置の基本構成を示す断面図及び平面図である。

【図3】図2に示した液晶表示装置の動作説明に供する 模式図である。

【図4】図2に示した液晶表示装置の製造方法を示す工 30 程図である。

【図5】図2に示した液晶表示装置の動作説明に供する 模式図である。

【図6】図2に示した液晶表示装置の動作説明に供する 模式図である。

35 【図7】本発明に係るプラズマアドレス液晶表示装置の 実施形態を示す断面図及び平面図である。

【図8】図7に示した実施形態の製造方法を示すフロー チャートである。

【図9】図7に示した実施形態の等価回路図である。

40 【図10】図7に示した液晶表示装置の配向状態をモデル化した模式図である。

【図11】図11に示した液晶表示装置の透過率/駆動電圧特性を示すグラフである。

【図12】図7に示した液晶表示装置の視角特性を示す 45 グラフである。

【図13】図1に示した液晶表示装置をモデル化した断面図である。

【図14】図1に示した液晶表示装置の等価回路図である。

0 【図15】図1に示した液晶表示装置の等透過率入力電

圧比/溝深さ特性を示すグラフである。

【図16】図1に示した液晶部印加電圧比/溝深さ特性を示すグラフである。

【図17】図7に示した実施形態をモデル化した断面図 である。

【図18】図17に示した液晶表示装置の等価回路図で ある。

【図19】図17及び図18でモデル化した液晶表示装置の等透過率入力電圧比/溝深さ特性を示すグラフである。

【図20】図17及び図18でモデル化した液晶表示装置の液晶部印加電圧比/溝深さ特性を示すグラフである。

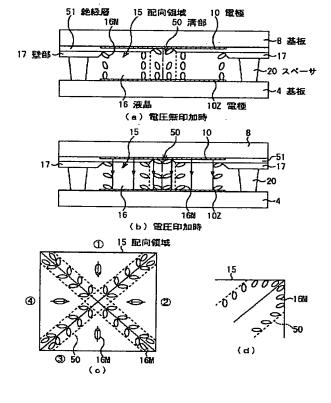
【図21】図1に示した実施形態の変形例を示す部分断面図である。

【図22】図1に示した実施形態の他の変形例を示す部分断面図である。

【図23】図1に示した実施形態の別の変形例を示す部 分断面図である。

【図24】図1に示した実施形態の更に別の変形例を示す部分断面図である。

【図1】



【図25】図7に示した液晶表示装置の変形例を示す部分断面図である。

【図26】図7に示した液晶表示装置の他の変形例を示す部分断面図である。

05 【図27】図7に示した液晶表示装置の別の変形例を示 す部分断面図である。

【図28】図1に示した実施形態の変形例を示す平面図である。

【図29】ECBモードを採用した液晶表示装置の透過 10 率/駆動電圧特性を示すグラフである。

【図30】本発明の変形例を示す模式的な平面図である。

【図31】本発明の他の変形例を示す模式的な平面図である。

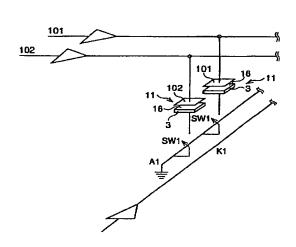
15 【図32】従来の液晶表示装置の一例を示す模式図である。

【符号の説明】

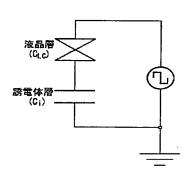
4 · · · 基板、8 · · · 基板、10 · · · 電極、10 Z · · · 電極、15 · · · 配向領域、16 · · · 液晶、1

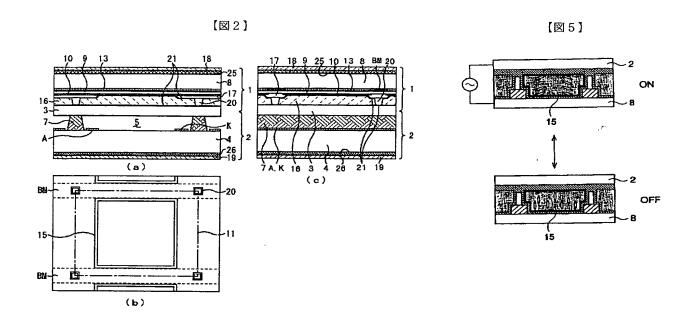
20 6 M・・・液晶分子、17・・・壁部、20・・・スペーサ、50・・・溝部、51・・・絶縁層

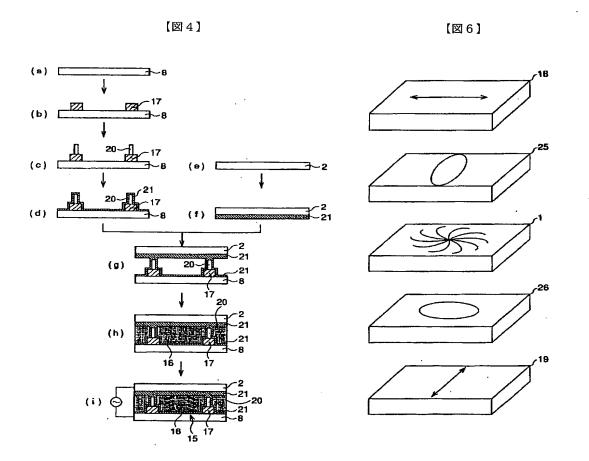
[図3]



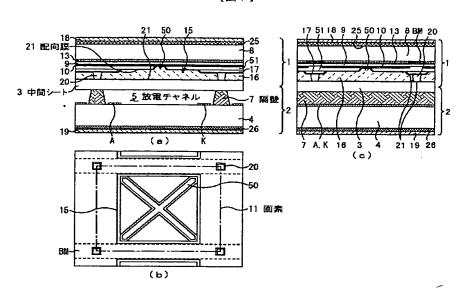
【図9】





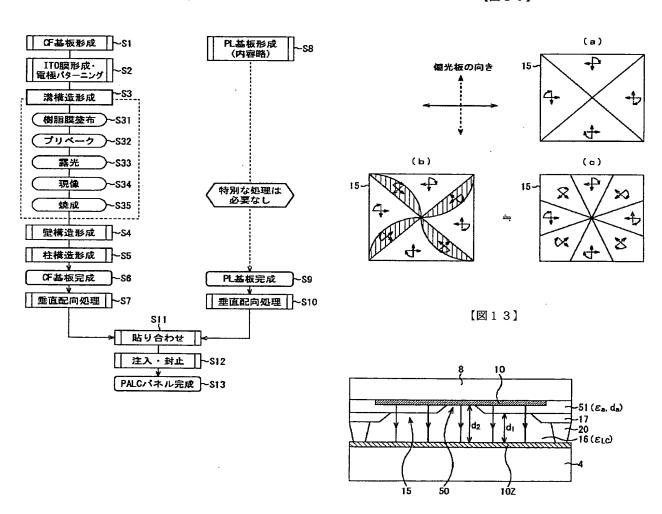


【図7】

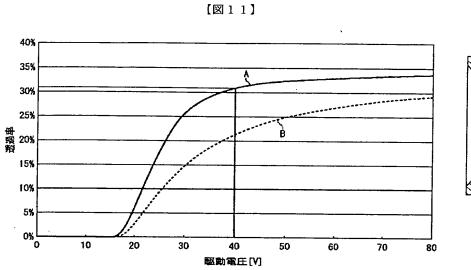


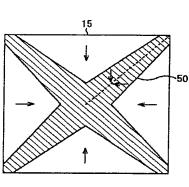
【図8】

【図10】

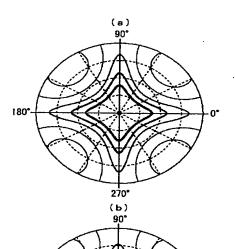


【図28】

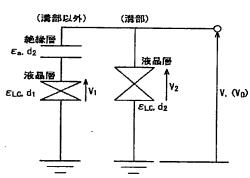




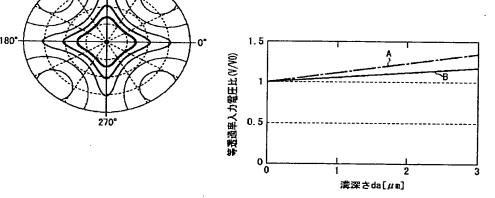
【図12】

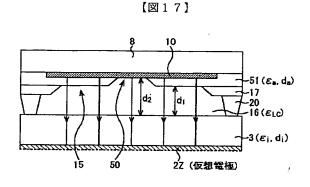


【図14】

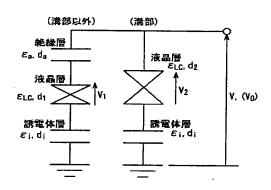


【図15】

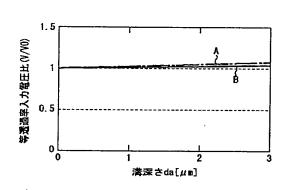




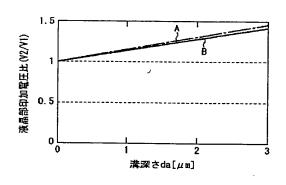
【図18】



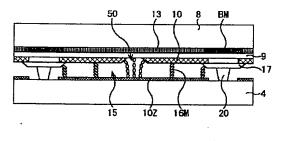
【図19】



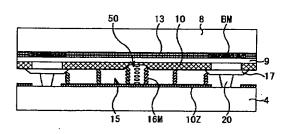
【図20】



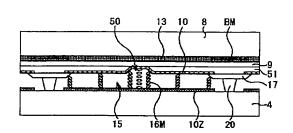
【図21】



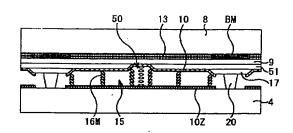
【図22】



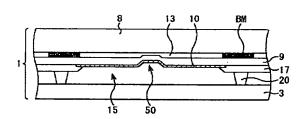
【図23】



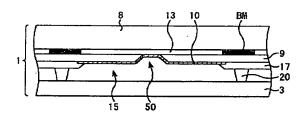
【図24】



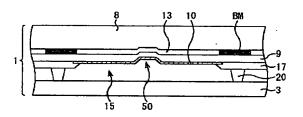
【図25】



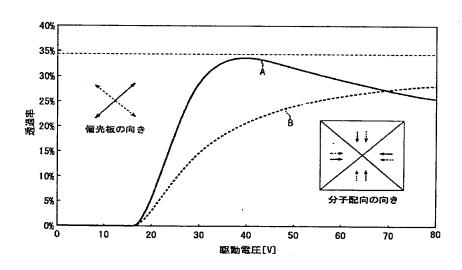
【図26】



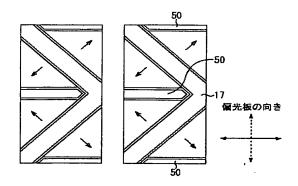
[図27]



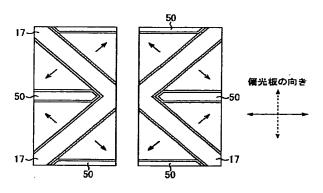
【図29】



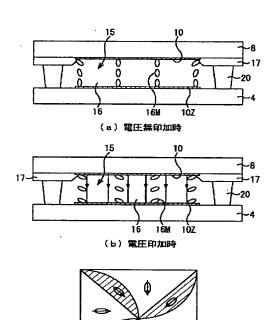
[図30]



【図31】



【図32】



(o)

フロントページの続き

(72)発明者 遠藤 和之

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72)発明者 内田 歳久

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

液晶表示装置及びその製造方法

特開2002-14353

Fターム(参考)	2H088	EA02	GA10	GA17	HA03	HA04	
		HA12	HA14	JA05	LA02	MA07	
	2H089	HA04	HA36	KA08	KA20	LA09	
		NA25	QA04	QA14	QA16	RA05	
		TA04	TA05	TA12	TA13		05
	2H090	HA03	HA04	HA07	HC12	HD11	
		KA05	KA11	LA02	LA09	LA15	
		MA01	MA15				
	2H091	FA02	Y FAOS	BX FAC	08Z F/	\35Y	
		FD04	GA06	GA07	GA08	HA07	10
		JA02	JA03	LA15	LA19		